# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-186542

(43) Date of publication of application: 15.07.1997

(51)Int.CI.

H03H 9/145 H03H 9/25

(21)Application number: 07-343584

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

(22) Date of filing:

28.12.1995

(72)Inventor: SAWADA YOICHI

# (54) SURFACE ACOUSTIC WAVE RESONATOR FILTER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a resonator filter with a sufficient band width in which short-circuit or damage of an electrode due to deposition of metallic powder or a foreign material is prevented.

SOLUTION: Plural interdigital electrodes 3–5 are formed on a 36° Y rotation cut LiTaO3 piezoelectric substrate 2, reflectors 6, 7 are formed to both sides of an area on which the plural interdigital electrodes 3–5 are formed in the propagation direction of a surface acoustic wave, an SiO2 film 8 is formed to an upper side of the plural interdigital electrodes 3–5 and the reflectors 6, 7, and the film thickness relation is expressed in equation

(h1+h2/2)/?≥0.06, where h1 is the film thickness of the interdigital electrodes 3-5, and the reflectors 6, 7, h2 is

the film thickness of the SiO2 film and? is is a

wavelength of a surface acoustic wave.

(h<sub>1</sub> + h<sub>2</sub> / 2) / λ ≥ 0. 0 8

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

07.08.2002

Date of sending the examiner's decision of

19.08.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-186542

(43)公開日 平成9年(1997)7月15日

(51) Int. Cl. 6		識別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
нозн	9/145		7259 — 5 J	H 0 3 H	9/145	С	
	9/25		7259 — 5 J		9/25	С	

審査請求 未請求 請求項の数1

OL

(全6頁)

(21)出願番号

特願平7-343584

(22)出願日

平成7年(1995)12月28日

(71)出願人 000006231

株式会社村田製作所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

(72)発明者 沢田 曜一

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(74)代理人 弁理士 宮▼崎▲ 主税 (外1名)

#### (54) 【発明の名称】弾性表面波共振子フィルタ

#### (57)【要約】

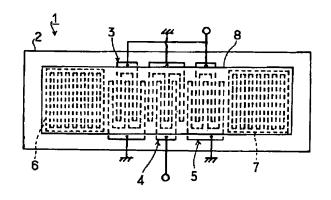
【課題】 金属粉や異物の付着による電極の短絡や損傷を防止することができ、かつ十分な帯域幅を有するSA W共振子フィルタを得る。

【解決手段】 36° Y回転カットのLiTaO3 圧電基板2上に、複数のインターデジタル電極3~5を形成し、複数のインターデジタル電極3~5が設けられている領域の表面波伝搬方向両側に反射器6,7を形成し、インターデジタル電極3~5及び反射器6,7の上面にSiO2 膜8を形成してなり、インターデジタル電極3~5及び反射器6,7の膜厚をh1、SiO2 膜の膜厚をh2、表面波の波長1としたときに、

#### 【数1】

 $(h, +h, /2) / \lambda \ge 0.06$  ..... (1)

の関係を満たすように設定されているSAW共振子フィルタ1。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 36°Y回転カットのLiTaO3圧電 基板上に、それぞれインターデジタルトランスデューサ を構成するための複数個のインターデジタル電極が形成 されており、かつ複数のインターデジタル電極が形成さ れている領域の表面波伝搬方向両側に反射器が形成され ている弾性表面波共振子フィルタにおいて、

前記インターデジタル電極及び反射器の表面にSiOa 膜が形成されており、該SiO2膜の膜厚をh2、イン ターデジタル電極及び反射器を形成している導電膜の膜 10 厚をhı、表面波の波長λとしたときに、

#### 【数1】

 $(h_1 + h_2/2)/\lambda \ge 0.06$  .....(1)

の関係を満たすように、インターデジタル電極、反射器 及びSiO2膜の厚みが設定されていることを特徴とす る、弾性表面波共振子フィルタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、圧電基板上にイン ターデジタルトランスデューサ(以下、IDT)を構成 するためのインターデジタル電極(ID電極)及び反射 器を形成してなる弾性表面波共振子フィルタに関し、特 に、圧電基板として36°Y回転カットのLiTaO3 基板を用い、かつID電極かつ反射器の形成されている 部分が改良された弾性表面波共振子フィルタに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、各種通信機器において、小型化及 び無調整化をはかるために、帯域フィルタとして弾性表 面波 (SAW) 共振子フィルタが広く用いられている。 また、通信機器の高周波化等に伴って、上記SAW共振 子フィルタの広帯域化が広く求められてきている。

【0003】そこで、SAW共振子フィルタにおいて広 帯域化を図るために、電気機械結合係数が大きい36° Y回転カットのLiTaO3基板を用い、該基板上に3 個のIDTを設け、縦0次モードと縦2次モードとを利 用した縦結合型2重モードSAW共振子フィルタにおい て、IDTと電気的に並列となる結合容量を設けた構成 が提案されている(特開平4-40705号公報)。こ の先行技術に記載のSAW共振子フィルタでは、上記 I 40 DT及び反射器の電極の膜厚をh1、表面波の波長 lと したときに、比h $/\lambda$ =0.03に設定されており、か つIDTを構成しているIDT電極の電極指中心間距離 を d とした場合、 d / L = 0. 50に設定することによ り、広帯域化が図られるとされている。

【0004】しかしながら、上記先行技術に記載のSA W共振子フィルタにおいても、一応の広帯域化は図り得 るものの、比帯域幅は、高々2%程度にすぎなかった。 そこで、同じく36° Y回転カットのLiTaO3 圧電 基板を用いて構成されたSAW共振子フィルタにおい

て、より一層の広帯域化を図り得る構造が特開平7-5 8581号公報に開示されている。ここでは、36°Y 回転カットのLiTaO₃基板上に3個のID電極が配

置されており、かつID電極が形成されている領域の表 面波伝搬方向両側に反射器が形成されている。また、広 帯域化を図るために、ID電極の同電位側の電極指の周

2

期をL、電極指交差幅をWとしたときに、 [0005]

【数2】

 $42 \times 50/R_L \leq W/L \leq 110 \times 50/R_L$ 

【0006】を満たすように同電位に接続される電極指 の周期L及び電極指交差幅Wが設定されており、かつI D電極の電極指中心間ピッチを d とした場合、

[0007]

【数3】

 $0.24 \le d/L \le 0.30$ 

【0008】を満たすように比d/Lが決定されてお り、さらに、ID電極及び反射器の電極の膜厚をh、、 表面波の波長んとしたときに、

[0009]

【数4】

 $h, / \lambda \ge 0.06$ 

【0010】を満たすように比h/λが設定されてい る。この構成によれば、比帯域幅は約3.7%、例えば 900MHz帯のフィルタにおいては帯域幅は約30M Hzとされ、従って、従来のSAW共振子フィルタに比 べて広帯域化が図られるとともに、リップルも1dB以 下に低減することが可能とされている。

【0011】また、この先行技術に記載の方法では、上 記ID電極及び反射器の電極の相対的膜厚(すなわち表 面波の波長に対して規格化された膜厚) h<sub>1</sub>/λは、従 来の弾性表面波共振子フィルタの場合に比べて約2倍に 設定されており、それによって上記広帯域化が実現され ている。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】上記のように、36° Y回転カットのLiTaO3 圧電基板を用いたSAW共 振子フィルタにおいて、特開平7-58581号公報に 記載のようにID電極及び反射器を構成すれば、十分な 帯域幅を得ることができる。

【0013】しかしながら、特開平7-58581号公 報に記載のSAW共振子フィルタでは、ID電極や反射 器が露出しているため、金属粉やその他の異物がID電 極や反射器に付着した場合に、短絡が生じたり、IDT が損傷したりするおそれがあった。

【0014】本発明の目的は、上述した従来技術の問題 点に鑑み、十分な帯域幅を実現し得るだけでなく、金属 粉やその他の異物の付着によるIDTの損傷を効果的に 50 防止し得るSAW共振子フィルタを提供することにあ

3

る。

## [0015]

【課題を解決するための手段】本発明は、36°Y回転 カットのLiTaOs 圧電基板上に、それぞれIDTを 構成するための複数個のID電極が形成されており、か つ複数のID電極が形成されている領域の表面波伝搬方 向両側に反射器が形成されているSAW共振子フィルタ において、前記ID電極及び反射器の表面にSiO2膜 が形成されており、該SiO2膜の膜厚をh2、ID電 極及び反射器を形成している導電膜の膜厚を h1、表面 10 波の波長 んとしたときに、下記の式 (1)

[0016]

【数5】

 $(h_1 + h_2/2)/\lambda \ge 0.06$  ..... (1)

【0017】の関係を満たすように、ID電極、反射器 及びSiО₂ 膜の厚みが設定されていることを特徴とす るSAW共振子フィルタである。

【0018】本発明のSAW共振子フィルタでは、圧電 基板として、電気機械結合係数が大きい36°Y回転カ ットのLiTaO₃ 圧電基板が用いられる。また、上記 のように、ID電極及び反射器の膜厚をh1、SiO2 膜の膜厚をh2 及び表面波の波長を λ としたときに、上 記式(1)を満たすようにこれらの値が決定されてお り、それによって十分な帯域幅を確保するとともに、S i O₂ 膜の存在により金属粉やその他の異物から I D電 極及び反射器が保護される。

【0019】すなわち、本願発明者は、通過帯域幅を十 分な大きさとし得る特開平7-58581号公報に記載 のSAW共振子フィルタを用い、上記金属粉やその他の 異物による付着によるID電極の損傷が生じる可能性に つき鋭意検討した結果、ID電極及び反射器の表面に、 保護膜を形成すれば、上記金属粉やその他の異物の付着 によるID電極の損傷を防止し得るのではないかと考 え、種々の材料を用いて実験を繰り返した。もっとも、 上記のように設けた保護膜により、ID電極の損傷が防 止されたとしても、通過帯域幅は十分な大きさに確保さ れねばならない。従って、このような観点から種々の材 料を用い、かつSAW共振子フィルタの種々のパラメー タを変更して実験したところ、保護膜としてSiO2膜 40 を用い、該SiО₂ 膜、ID電極及び反射器を上記式

(1)を満たすように設定すれば、ID電極の損傷を防 止し得るだけでなく、通過帯域幅も十分な大きさに確保 されることを見い出し、本発明をなすに至った。

【0020】すなわち、本発明は、特開平7-5858 1号公報に記載の広い帯域幅を得ることができるSAW . 共振子フィルタの電極部分に単に保護膜を設けただけで は、上記課題を達成し得ないことを見い出し、本願発明 者により実験的に確かめられたものである。

たすようにSiО₂ 膜の膜厚h₂、ID電極及び反射器 の膜厚 h 1 及び表面波の波長 λ を設定して初めて、S i O2膜を保護膜として用いたとしても、十分な帯域幅を 得ることができるのであるが、保護膜としてSiO2膜 を選択し得たとしても、該保護膜の膜厚、ID電極及び 反射器の膜厚と表面波の波長えとの関係を選択すれば、

保護膜を設けたSAW共振子フィルタにおいてさらに帯 域幅も十分な値に確保し得ることは、従来全く知られて いなかったことを指摘しておく。

【0022】本発明においては、36°Y回転カットの LiTaOs 基板が用いられている。36° Y回転カッ トのLiTaOa基板は、電気機械結合係数が大きく、 かつ温度による周波数変動が小さい。従って、本発明の SAW共振子フィルタでは、36°Y回転カットのLi TaO<sub>3</sub> 圧電基板を用いているため、後述のように広い 通過帯域幅を得ることができるだけでなく、温度特性に おいても良好なSAW共振子フィルタを構成し得る。

【0023】本発明では、上記LiTaOa 圧電基板上 に、複数個のID電極が形成されている。すなわち、各 I D電極を圧電基板上に形成することにより、それぞれ IDTが構成されている。各ID電極は、周知のよう に、互いに間挿し合う複数本の電極指を有する一対のく し型電極により構成されている。

【0024】上記複数のID電極の数は特に限定される ものではないが、広帯域化を図り得るだけでなく、小型 化を進めるためには、好ましくは、3個のID電極が形 成され、それによって3電極型のSAW共振子フィルタ が構成される。もっとも、4個以上のID電極が形成さ れ、それによって多電極型のSAW共振子フィルタとし てもよい。

【0025】また、ID電極においては、周知の重み付 け法に従って、交差幅重み付けや間引き電極法により重 み付けが施されていてもよい。複数のID電極が形成さ れている領域の表面波伝搬方向両側には、反射器が形成 されている。両側に設けられた反射器は、該反射器間に おいて発生した表面波を閉じ込め、定在波とし、縦結合 型2重モードSAW共振子フィルタを構成するために設 けられている。この反射器については、上記表面波を閉 じ込め得る限り、適宜の構造とし得るが、通常、表面波 伝搬方向に直交する方向に延びる複数本の電極指を有す るグレーティング反射器が用いられる。

【0026】上記ID電極及び反射器は、任意の導電性 材料で構成することができるが、通常、SAW装置にお いて電極材料として慣用されているアルミニウムやアル ミニウム合金が用いられる。

【0027】SiOz 膜は、上記ID電極及び反射器の 表面を被覆するように形成される。このSiO2膜は、 圧電基板上の他の領域に至るように形成されていてもよ い。もっとも、SAW共振子フィルタを外部と接続する 【0021】なお、本発明のように、上記式(1)を満 50 ための電極パッドは、ワイヤーボンディングを行うため

に露出されている必要がある。従って、好ましくは、上記電極パッドが設けられている部分の上面には $SiO_2$  膜は形成されない。 $SiO_2$  膜の形成は、蒸着、スパッタリング等の適宜の薄膜形成方法を用いて行うことができ、特に限定されるものではない。

#### [0028]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の一実施形態にかかるSAW共振子フィルタを示す略図的平面図であり、図2は、 $SiO_2$ 膜を除去した上記実施形態にかかるSAW共振子フィルタの略図的平面図である。なお、図1及び図2においては、ID電極を外部と接続するために電極パッドについては図示を省略してあることを指摘しておく。

【0029】図1に示すSAW共振子フィルタ1は、36° Y回転カットの $LiTaO_3$ よりなる圧電基板2を用いて構成されている。圧電基板2上には、第1~第3のID電極3~5が形成されており、それによって、それぞれ、第1~第3のIDTが構成されている。

【0030】図2に示すように、ID電極3は、一対のくし型電極3a,3bを有する。くし型電極3a,3b 20は、それぞれ複数本の電極指を有し、くし型電極3aの電極指とくし型電極3bの電極指は互いに間挿し合っている。第2,第3のID電極4,5も、第1のID電極3と同様に、一対のくし型電極4a,4b,5a,5bを有する。

【0031】ID電極3~5が形成されている領域の表面波伝搬方向両側には、グレーティング反射器6,7が形成されている。反射器6,7は、それぞれ、表面波伝搬方向に直交する方向に延びる複数本の電極指6a,7aを有する。複数本の電極指6a,7aは、両端におい30て相互に電気的に接続されている。

【0032】本実施形態では、ID電極3~5及び反射器6,7は、A1薄膜により構成されている。ID電極3~5及び反射器6,7の形成は、圧電基板2の上面の全面にA1よりなる薄膜を形成した後、フォトリソグラフィー技術を用いて所定の形状とすることにより行われている。

【0033】また、ID電極 $3\sim5$ 及び反射器6, 7が 形成されている部分には、図1に示す $SiO_2$  膜8が形成されている。図3は、 $COSiO_2$  膜8が形成されて 40いる部分の一部を示す部分切欠断面図である。図1から明らかなように、 $SiO_2$  膜は、ID電極 $3\sim5$ 及び反射器6, 7の少なくとも電極指が設けられている部分を被覆するように圧電基板2の上面に形成されている。

【0034】次に、本実施形態のSAW共振子フィルタ 1において、通過帯域幅を広げるとともに、SiO2膜 8の形成により金属粉やその他の異物によるID電極の 損傷を防止し得る構成及び条件について、具体的な実験 例を参照しつつ説明する。

【0035】SAW共振子フィルタ1では、通過帯域幅 50 ップバンド幅を広げ得ることがわかる。

の上限は、反射器 6, 7のストップバンド幅で制限される。従って、SAW共振子フィルタ 1 において、広帯域化を図るには、反射器 6, 7のストップバンド幅を広げればよい。

6

【0036】800MHz帯のPDC用フィルタとしてSAW共振子フィルタ1を構成する場合を例にとり説明する。まず、SAW共振子フィルタ1において、通過帯域、温度変動分、経時変動分及び製造上の公差の全てを考慮すると、800MHz帯のフィルタでは、必要帯域幅は26MHz程度となる。また、省電力化のために、低損失化が求められており、従って、SAW共振子フィルタにおいても、フィルタの挿入損失は2.2dB以下であることが求められている。

【0037】そこで、挿入損失が2.2dBであり、かつ通過帯域幅が26MHz(比帯域幅3.2%)となるフィルタについて、シュミレーションによりストップバンドの比帯域幅を計算すると、ストップバンドの比帯域幅は約4.7%となった。従って、挿入損失を2.2dB以下、通過帯域幅を26MHz以上とするには、ストップバンドの比帯域幅は4.7%以上であることが必要である。

【0038】そこで、ストップバンド幅を広げるべく、 I D電極 $3\sim5$ 及び反射器6, 7の膜厚のSAWの波長に対する比 $h_1/\lambda$ の変化によるストップバンド幅の変化を調べたところ、図4に破線Aで示す結果が得られた。

【0039】図4の破線Aから明らかなように、ID電極 $3\sim5$ 及び反射器6, 7の膜厚の表面波の波長 $\lambda$ に対する比 $h_1/\lambda$ が大きくなるほど、ストップバンドの比帯域幅が大きくなることがわかる。

【0040】また、本願発明者は、上記Si〇 $_2$  膜8のストップバンドへの影響について初めて着目し、SiO $_2$  膜8の膜厚 $_1$  の表面波の波長 $_1$  に対する比 $_1$  んを変化させた場合のストップバンドの変化を測定したところ、図4に実線Bで示す結果が得られた。すなわち、図4から明らかなように、SiО $_2$  膜の膜厚を変化させた場合と、膜厚比 $_1$  んを大きくするに連れストップバンドの比帯域幅が大きくなることがわかる。また、図4の破線Aと、実線Bとを比較すれば明らかなように、ストップバンドの比帯域幅を増大させる効果は、 $_1$  んを変化させた場合の約1/2であることがわかる。

【0041】従って、図4に示した結果から、I D電極  $3\sim5$  及び反射器6, 7 の上記膜厚比 $h_1$  /  $\lambda$  を増大させることによりストップバンド幅を広げる効果は、I D 電極  $3\sim5$  及び反射器6, 7 の膜厚比 $h_1$  /  $\lambda$  の 2 倍に相当する  $h_2$  /  $\lambda$  となる S i  $O_2$  膜 8 を形成することにより達成されることがわかる。言い換えれば、 $h_1$  /  $\lambda$  を一定としても、 $h_2$  /  $\lambda$  を変化させることによりストップバンド幅を広げ得ることがわかる

7

【0042】図5は、比h1/2が0.057の場合に、他のパラメータを変えることなく、SiO2 膜8の膜厚比h2/2だけを変化させて、反射器のストップバンド幅を測定した場合の結果を示す。図5から明らかなように、SiO2 膜8の膜厚比h2/2を増加させることにより、ストップバンドの比帯域幅が増加していることがわかる。

【0043】図5から、ストップバンドの比帯域幅が、4.7%以上となるのは、 $h_2/\lambda$ が0.006以上であることがわかる。従って、I D電極 $3\sim5$  及び反射器 106, 7の膜厚比 $h_1/\lambda$ と、 $SiO_2$  膜8の膜厚比 $h_2/\lambda$ の2分の1とを加えたものが、次の式 (1)

[0044]

【数6】

 $(h_1 + h_2/2)/\lambda \ge 0.06$  ..... (1)

【0045】を満たすように構成すれば、挿入損失が2.2dB以下であり、通過帯域幅は26MHz以上のSAW共振子フィルタ1を実現し得ることがわかる。 【0046】よって、本実施形態のSAW共振子フィル20タ1では、上記第1~第3のID電極及び反射器6,7、SiO2膜及び表面波の波長 λの関係が、上記式

(1) を満たすように構成されており、それによって、挿入損失が小さく、十分な通過帯域幅を有し、さらに、SiO2 膜がID電極及び反射器を被覆しているため、金属粉や異物の付着によるIDTの損傷が生じ難いSAW共振子フィルタとされていることがわかる。

【0047】上記式 (1) を満たすように、SAW 共振子フィルタを構成した場合に、実際に広い帯域幅及び小さな挿入損失を実現し得ることを、具体的な実験例に基 30 づき確かめた。図6は、SAW 共振子フィルタ1の実施例として、 $h_1/\lambda=0$ . 057、 $h_2/\lambda=0$ . 01 4として構成したSAW 共振子フィルタの周波数特性を示す。

【0048】図6から明らかなように、挿入損失が2.2dBの帯域幅は28MHzとなっており、従って、十分な帯域幅を有することがわかる。よって、式(1)を満たすように、SAW共振子フィルタ1を構成すること

により、SiО₂ 膜8によりIDTの損傷を防止し得るだけでなく、十分な帯域幅を確保し得ることがわかる。 【0049】

8

【発明の効果】本発明のSAW共振子フィルタでは、I D電極及び反射器表面に $SiO_2$  膜が形成されているため、金属粉や異物が付着したとしても、短絡等の事故やI DTの損傷等が効果的に防止される。加えて、上記 $SiO_2$  膜を形成したとしても、I D電極及び反射器の膜厚 $h_1$ 、 $SiO_2$  膜の膜厚 $h_2$  及び表面波の波長 $\lambda$ が、上述した式(1)を満たすように設定されているため、通過帯域幅も十分な大きさに確保される。

【0050】よって、広帯域であるだけでなく、信頼性に優れたSAW共振子フィルタを提供することができ、かつSAW共振子フィルタの生産に際しての歩留りを高めることが可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態にかかるSAW共振子フィルタを説明するための略図的平面図。

【図2】本発明の一実施形態にかかるSAW共振子フィ ) ルタにおいて、SiO2 膜を取り除いた状態を示す略図 的平面図。

【図3】図1に示した実施形態のSAW 共振子フィルタにおいて、 $SiO_2$  膜が形成されている部分を拡大して示す部分切欠断面斜視図。

【図4】比h1 / λ及びh2 / λとストップバンドの比帯域幅との関係を示す図。

【図5】比 $h_1/\lambda$ を一定とした場合に、比 $h_2/\lambda$ を変化させた場合のストップバンドの比帯域幅の変化を示す図。

30 【図6】本発明の一実施例として試作したSAW共振子 フィルタの周波数特性を示す図。

### 【符号の説明】

1…SAW共振子フィルタ

2…圧電基板

3~5…ID電極

3 a, 3 b, 4 a, 4 b, 5 a, 5 b … くし型電極 6, 7 … 反射器

8…SiO2膜

